

SECCIÓN H — ELECTRICIDAD

H05 TECNICAS ELECTRICAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR

H05H TECNICA DEL PLASMA (tubos de haz iónico H01J 27/00; generadores magnetohidrodinámicos H02K 44/08; producción de rayos X utilizando la generación de un plasma H05G 2/00); **PRODUCCION DE PARTICULAS ACELERADAS ELECTRICAMENTE CARGADAS O DE NEUTRONES** (obtención de neutrones a partir de fuentes radiactivas G21, p. ej. G21B, G21C, G21G); **PRODUCCION O ACELERACION DE HACES MOLECULARES O ATOMICOS NEUTROS** (relojes atómicos G04F 5/14; dispositivos que utilizan la emisión estimulada H01S; regulación de la frecuencia por comparación con una frecuencia de referencia determinada por los niveles de energía de moléculas, de átomos o de partículas subatómicas H03L 7/26)

Nota(s) [3]

- (1) La presente subclase cubre:
- (a) la producción o la manipulación del plasma;
 - (b) los dispositivos no cubiertos por la subclase H01J y en los que los electrones, haces de iones o de partículas neutras son aceleradas hacia energías elevadas;
 - (c) los dispositivos destinados a producir haces de partículas neutras;
 - (d) de blancos relativos a los objetos (a), (b) o (c).
- (2) Es importante tener en cuenta la subclase G21K .

Índice de subclase

TECNICA DEL PLASMA	1/00	Lineales; de inducción magnética;
PRODUCCION O ACELERACION DE		de resonancia magnética..... 9/00; 11/00;
HACES DE PARTICULAS NEUTRAS.....	3/00	13/00
BLANCOS PARA LA PRODUCCION DE		Otros..... 15/00
REACCIONES NUCLEARES	6/00	Detalles..... 7/00
ACELERADORES		
De tensión continua o		
monoimpulsos.....	5/00	

1/00 Producción del plasma; Manipulación del plasma (aplicación de la técnica del plasma a reactores de fusión termonuclear G21B 1/00) [1, 2006.01]	1/18	. . . en donde los campos oscilan a muy altas frecuencias, p. ej. en la banda de microondas [1, 2006.01]
1/02 . Disposiciones para confinar el plasma por medio de campos eléctricos o magnéticos; Disposiciones para calentar el plasma (óptica electrónica H01J) [1, 2006.01]	1/20	. . . Calefacción óhmica [1, 2006.01]
	1/22	. . . para calefacción por inyección [1, 2006.01]
	1/24	. . . Producción del plasma [2, 2006.01]
1/03 . . . utilizando campos electrostáticos [3, 2006.01]	1/26	. . . Antorchas de plasma [2, 2006.01]
1/04 . . . utilizando campos magnéticos sustancialmente generados por la descarga en el plasma [1, 2006.01]	1/28	. . . Disposiciones para el enfriamiento [3, 2006.01]
	1/30	. . . utilizando campos electromagnéticos aplicados, p. ej. energía a alta frecuencia o en forma de microondas (H05H 1/28 tiene prioridad) [3, 2006.01]
1/06 . . . Dispositivos de retención longitudinal [1, 2006.01]	1/32	. . . utilizando un arco (H05H 1/28 tiene prioridad) [3, 2006.01]
1/08 . . . Dispositivos de retención theta [1, 2006.01]	1/34	. . . Detalles, p. ej. electrodos, toberas [3, 2006.01]
1/10 . . . utilizando solamente campos magnéticos aplicados [1, 2006.01]	1/36	. . . Disposiciones de circuitos (H05H 1/38, H05H 1/40 tienen prioridad) [3, 2006.01]
1/11 . . . utilizando una configuración en aguja (H05H 1/14 tiene prioridad) [3, 2006.01]	1/38	. . . Guiado o centrado de electrodos [3, 2006.01]
1/12 . . . en donde el recinto forma un bucle cerrado [1, 2006.01]	1/40	. . . utilizando campos magnéticos aplicados, p. ej. para enfocar o para hacer girar el arco [3, 2006.01]
1/14 . . . en donde el recinto es recto y tiene un espejo magnético [1, 2006.01]		
1/16 . . . utilizando campos eléctricos o magnéticos [1, 2006.01]		

- 1/42 con disposiciones para la introducción de materiales en el plasma, p. ej. polvo, líquido (pulverización electrostática, aparatos de pulverización con medios para cargar eléctricamente el pulverizante B05B 5/00) [3, 2006.01]
- 1/44 utilizando varias antorchas [3, 2006.01]
- 1/46 utilizando campos electromagnéticos aplicados, p. ej. energía a alta frecuencia o en forma de microondas (H05H 1/26 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 1/48 utilizando un arco (H05H 1/26 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 1/50 y utilizando campos magnéticos aplicados, p. ej. para enfocar o para hacer girar el arco [3, 2006.01]
- 1/52 utilizando hilos explosivos o espinterómetros (H05H 1/26 tiene prioridad; espinterómetros en general H01T) [3, 2006.01]
- 1/54 Aceleradores de plasma [3, 2006.01]
- 3/00 Producción o aceleración de haces de partículas neutras, p. ej. de haces moleculares o atómicos [3, 2006.01]**
- 3/02 Producción de un haz molecular o atómico, p. ej. de un haz resonante (másers de gas H01S 1/06) [3, 2006.01]
- 3/04 Aceleración por la presión de una onda electromagnética [3, 2006.01]
- 3/06 Producción de haces de neutrones (blancos para la producción de reacciones nucleares H05H 6/00; fuentes de neutrones G21G 4/02) [5, 2006.01]
- 5/00 Aceleradores de tensión continua; Aceleradores que utilizan impulsos únicos (H05H 3/06 tiene prioridad) [1, 5, 2006.01]**
- 5/02 Detalles (blancos para la producción de reacciones nucleares H05H 6/00) [1, 3, 2006.01]
- 5/03 Tubos de aceleración (ampollas o recipientes de tubos de descarga que tienen una distribución de potencial mejorada sobre la superficie de la ampolla H01J 5/06; blindaje de tubos de rayos X asociados con las ampollas o recipientes H01J 35/16) [4, 2006.01]
- 5/04 alimentados por generadores electrostáticos, p. ej. generador de Van de Graaff [1, 4, 2006.01]
- 5/06 Aceleradores en serie; Aceleradores de etapas múltiples [1, 2006.01]
- 5/08 Aceleradores de partículas que utilizan transformadores elevadores, p. ej. transformadores de resonancia [4, 2006.01]

- 6/00 Blancos para la producción de reacciones nucleares (soportes para blancos u objetos a irradiar G21K 5/08) [3, 2006.01]**
- 7/00 Detalles de dispositivos de los tipos cubiertos por los grupos H05H 9/00-H05H 13/00 (blancos para la producción de reacciones nucleares H05H 6/00) [1, 3, 2006.01]**
- 7/02 Circuitos o sistemas para suministrar energía a alta frecuencia (generadores a alta frecuencia H03B) [1, 2006.01]
- 7/04 Sistemas de imanes; Su excitación [1, 2006.01]
- 7/06 Disposiciones de dos haces; Disposiciones de multihaces [1, 2006.01]
- 7/08 Disposiciones para situar las partículas sobre sus órbitas [1, 2006.01]
- 7/10 Disposiciones para extraer las partículas de sus órbitas [1, 2006.01]
- 7/12 Disposiciones para variar la energía final de un haz [1, 2006.01]
- 7/14 Cámara de vacío (H05H 5/03 tiene prioridad) [4, 2006.01]
- 7/16 del tipo guía de onda [4, 2006.01]
- 7/18 Cavidades; Resonadores [4, 2006.01]
- 7/20 con paredes superconductoras [4, 2006.01]
- 7/22 Detalles de los aceleradores lineales, p. ej. tubos de desviación (H05H 7/02-H05H 7/20 tienen prioridad) [4, 2006.01]
- 9/00 Aceleradores lineales (H05H 11/00 tiene prioridad) [1, 2006.01]**
- 9/02 Aceleradores lineales de ondas progresivas [1, 2006.01]
- 9/04 Aceleradores lineales de ondas estacionarias [1, 2006.01]
- 11/00 Aceleradores de inducción magnética, p. ej. betatrones [1, 2006.01]**
- 11/02 Betatrones de núcleo de aire [1, 2006.01]
- 11/04 Betatrones con campo magnético continuo superpuesto [1, 2006.01]
- 13/00 Aceleradores de resonancia magnética; Ciclotrones [1, 2006.01]**
- 13/02 Sincrociclotrones, es decir, ciclotrones modulados en frecuencia [1, 2006.01]
- 13/04 Sincrotrones [1, 2006.01]
- 13/06 Aceleradores de resonancia magnética de núcleo de aire [1, 2006.01]
- 13/08 Aceleradores de resonancia magnética de gradiente alternativo [1, 2006.01]
- 13/10 Aceleradores que comprenden una o varias secciones de aceleración lineal e imanes de curvatura o de dispositivos análogos para hacer volver las partículas cargadas a una trayectoria paralela a la primera sección de aceleración, p. ej. microtrones [4, 2006.01]
- 15/00 Métodos o dispositivos para acelerar partículas cargadas no previstos en otros lugares [4, 2006.01]**